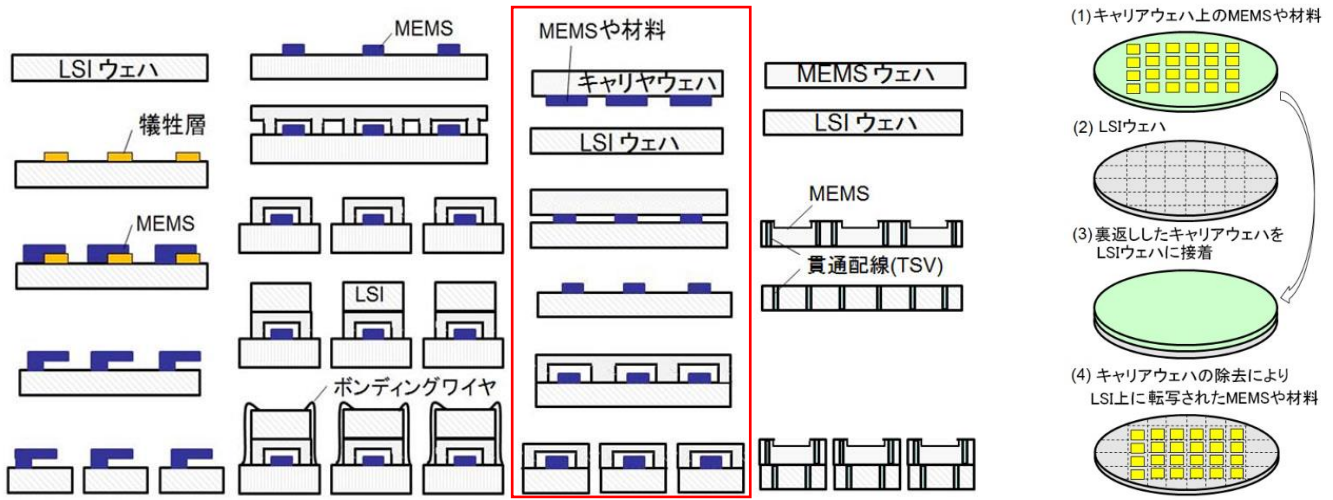
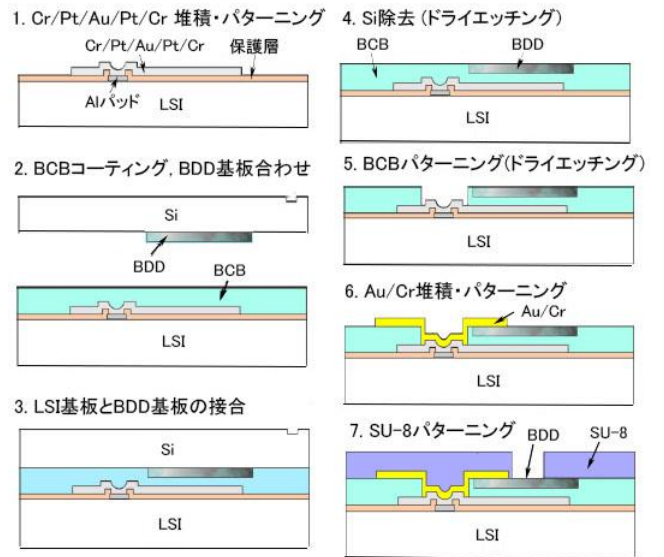
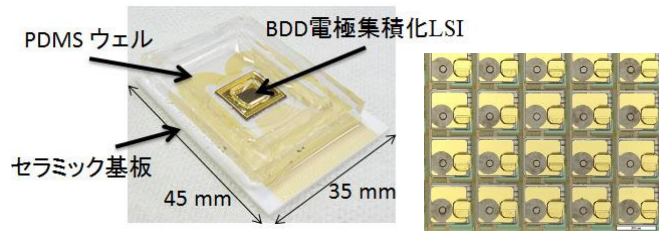
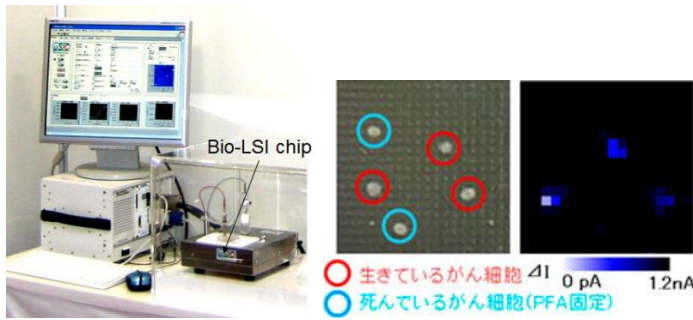


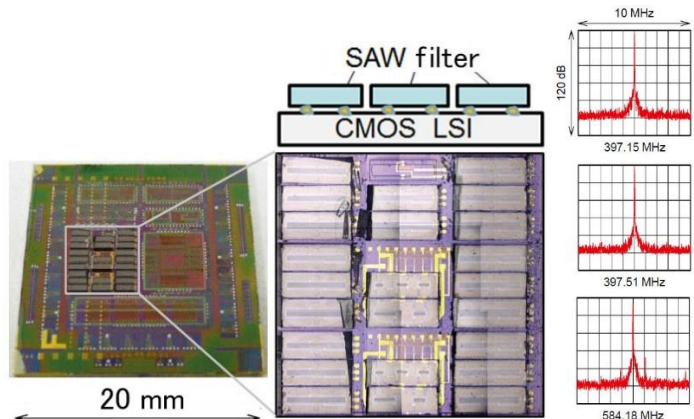
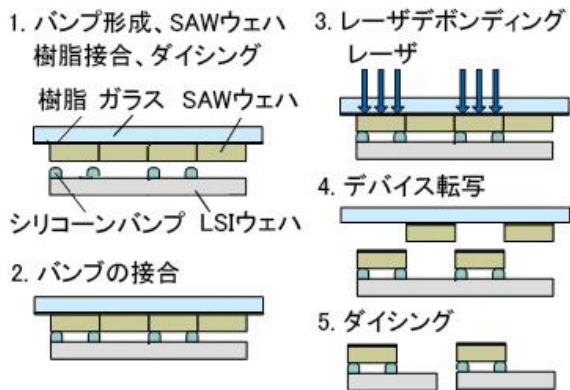
# LSI 上への MEMS の転写によるヘテロ集積化



(a) 表面マイクロマシン (b) 別チップの MEMS と (c) LSI 上への MEMS (d) 貫通配線(TSV)による接続  
 グ (MEMS 工程の制約) LSI の組立 (配線の制約) や材料の転写による接続



ボロンドープダイヤモンド(BDD)膜を LSI 上に転写したバイオ LSI (末永教授)



選択転写工程とそれを用いた LSI 上マルチ SAW フィルタ